

Влияние технологического микроклимата на качество изделий микроэлектроники

Kaipoksin, L.; Puusepp, Ü.; Rätsep, Ülo; Teevet, J.-T. Электронная промышленность : ЭП : научно-технический сборник 1983 / с. 76-79 : илл https://www.ester.ee/record=b1802011*est

Метод исследования технологического процесса производства интегральных микросхем, основанный на анализе кластеров состояний

Rätsep, Ülo; Teevet, J.-T. Методы и средства обработки сигналов при наличии шумов 1982 / с. 39-43

https://www.ester.ee/record=b1312255*est <https://www.etera.ee/zoom/121735/view?page=1&p=separate&search=true&tool=search>

Определение структуры статистических закономерностей методом кластеризации наблюдений

Budarin, Vladimir; Rätsep, Ülo; Teevet, J.-T. Электронная техника. Серия 9, Экономика и системы управления : научно-технический сборник 1981 / с. 45-49 : илл https://www.ester.ee/record=b2160900*est

Прогнозирование качества интегральных микросхем на основе кластеров состояний

Budarin, Vladimir; Rätsep, Ülo; Teevet, J.-T. Методы и средства цифровой обработки сигналов 1984 / с. 111-115

https://www.ester.ee/record=b1302208*est <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/e49ece5a-b726-4a2f-860f-748b84670a0c>